

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成23年4月21日(2011.4.21)

【公開番号】特開2010-232195(P2010-232195A)

【公開日】平成22年10月14日(2010.10.14)

【年通号数】公開・登録公報2010-041

【出願番号】特願2010-156306(P2010-156306)

【国際特許分類】

H 0 1 J 37/317 (2006.01)

H 0 1 J 37/20 (2006.01)

【F I】

H 0 1 J 37/317 D

H 0 1 J 37/20 A

【手続補正書】

【提出日】平成23年3月7日(2011.3.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

集束イオンビーム光学系と、当該集束イオンビーム光学系とビーム軸同士が交差するよう
に配置された電子ビーム光学系と、試料を載置する試料台をその内部に有する真空試料
室と、を備えた微小試料加工観察装置に搭載できる移送手段であって、

イオンビームの照射により試料から分離された微小試料を支持するプローブを有し、前
記真空試料室の内部において当該プローブを回転させて前記微小試料の姿勢を制御するよ
うに構成された移送手段。